Plasma à pression atmosphérique:

DBD

et

LABORATOIRE PROCÉDÉS, MATÉRIAUX et ENERGIE SOLAIRE

UPR 8521 du CNRS. conventionnée avec l'université de Perpignan

PROCESSES,MATERIALS and SOLAR ENERGY LABORATORY

conception de réacteur

 Françoise Massines

CNrS

PROMES

 \times UPVD

DBD?

Décharge contrôlée par barrière diélectrique ou

la solution la plus robuste pour obtenir un plasma froid à la pression atmosphérique

Développement de procédé ?

Pour optimiser un procédé il faut choisir le mode de génération du plasma **et** la façon de le mettre en œuvre → réacteur

Plasma froid à pression atmosphérique: où est le Pb? P_{atm} = haute pression pour un plasma

- La fréquence de collision augmente avec n_g
- Le libre parcours moyens, λ , des espèces diminue :

Electrons: $\lambda_e \approx 500$ nm

- ⇒ Gap du millimètre ou plus:
 - ⇒ ionisation très rapide et localisée du gaz
 - ⇒ électrons se thermalisent, chauffent le gaz
 ⇒ arc électrique

Pour générer un plasma froid à la pression atmosphérique il faut bloquer le développement de la décharge.

- Plasma froid : $n_e/n_g < 10^{-4}$
- Pression atmosphérique: n_{gaz}≈2,510¹⁹/cm³

Introduction

Caractéristiques électroniques



CNRS

PROMES

Sommaire

I-Pourquoi faire des décharges froides à pression atmosphérique ?

- 1. Parce qu'on a pas le choix
- 2. Pour réduire le coût d'un procédé
- 3. A cause de la spécificité de la cinétique chimique

II- Physique des décharges hors équilibre à la pression atmosphérique ?

- 1. Comment la décharge s'amorce lorsque Pxd est élevé ? - le streamer en 5 étapes
- 2. Comment éviter la transition à l'arc ?
 - Décharge couronne
 - Décharge nanoimpulsionnelle
 - Décharge contrôlée par barrière diélectrique
- 3. Quelles sont les caractéristiques des micro-décharges ?
- 4. Décharges homogènes à la pression atmosphérique
 - Couplage des avalanches électroniques
 - Claquage de Townsend à pression atmosphérique
- 5. Comparaison des différentes DBD

CNRS PROMES

III- Développement d'un procédé: cas de la PECVD

Domaines d'applications



Le procédé doit fonctionner à l'atmosphère

Bio-ingénierie





Contrôle de l'écoulement



Sans Avec plasma plasma Combustion



Sans Avec plasma plasma

 Réduction des Nox,
 Sox, particules dans les gaz d'échappement



Fonctionner à la pression atmosphérique **réduit le coût**

• Activation de la surface de km² de film par traitement corona



Caoutchouc

Tissus

Bois







Dépôt de couches minces

puis en atmosphère contrôlée Contrôle de la chimie

Le procédé utilise la spécificité de la cinétique chimique à pression atmosphérique

<u>A pression atmosphérique toutes les réactions qui implique le gaz</u> principal sur le niveau fondamental (M) sont dominantes

En particulier, c'est le cas

- des réactions de 'quenching' :
 A* + M → A + M*
- des réactions à 3 corps :

 $A + B + M \rightarrow AB + M$ $A^* + B + M \rightarrow A + B^* + M$ $A^+ + B + M \rightarrow AB^+ + M$

⇒ Lampes à excimer⇒ Ozone

Réactions à 3 corps: formation d'excimer Influence sur les <u>états excités</u> présents dans la décharge

Génération d'excimers dans les lampes UV ou VUV

Ex : dimère de gaz rare – cas d'une décharge dans le Xénon pur



http://gaphyor.lpgp.u-psud.fr/index-fr.html

 $e + Xe \rightarrow e + Xe^*$

puis (1) $Xe^* \rightarrow Xe + hv (147 nm)$ ou (2) $Xe^* + 2Xe \rightarrow Xe_2^* + Xe$ suivi de $Xe_2^* \rightarrow 2Xe + hv (172 nm)$

→ Le chemin cinétique dominant (1 ou 2) dépend de la pression de travail

Réactions à 3 corps

Influence sur les états excités présents dans la décharge

<u>Génération d'excimères dans les lampes UV ou VUV</u>

Ex : dimère de gaz rare - cas d'une décharge dans le Xénon pur

(1) $Xe^* \rightarrow Xe + hv$ (147 nm) ou (2) $Xe^* + 2Xe \rightarrow Xe_2^* + Xe$ (172nm) $v_1 = 1.10^4 s^{-1}$ $k_2 = 2.10^{-32} \text{ cm}^6.s^{-1}$

A 1 mbar, [Xe] = $2,6.10^{16}$ cm⁻³:

 $v_1 = 1.10^4 s^{-1} \gg v_2 = k_2^* [Xe]^2 \approx 1.10^1 s^{-1}$ \rightarrow émission principalement à 147 nm

A 1000 mbar, [Xe] = 2,6.10¹⁹ cm⁻³ :

 $v_1 = 1.10^4 s^{-1} \leftrightarrow v_2 = k_2^* [Xe]^2 \approx 1.10^7 s^{-1}$ \rightarrow émission principalement à 172 nm

Réactions à 3 corps

Influence sur les états excités présents dans la décharge

Génération d'excimères dans les lampes UV ou VUV



Le rayonnement à 147 nm peut être autoabsorbé, pas celui à 172 nm !!! meilleur rendement VUV à hautes pressions

Réactions à 3 corps

Influence sur les états excités présents dans la décharge

Génération d'excimères dans les lampes UV ou VUV

100

150

120

170

Longueur d'onde

150

<u>Ex</u> : excimère halogène-gaz rare \rightarrow Recombinaison ion - ion



200

150

200

Longueur d'onde

200

250 280

330

Applications : source de lumière excimer Lampe dans le visible

□ Principe



Avantages

Fonctionne quelque soit la température

 ✓ Fonctionnement instantané (Photocopieur) Pas de temps de mise en température, pulse de 100ns)
 ✓ Flexibilité de la forme

Applications : source de lumière excimer

Lampe dans le visible

Lampe plate de grande dimensions



✓ Configuration coplanaire

✓ Eclairage par l'arrière des écrans à cristaux liquides

Réactions à 3 corps Influence sur le <u>chemin cinétique</u>

$$e + O_2 \rightarrow 2 O^\circ$$

 $O_2 + O^\circ + M \rightarrow O_3 + M$
 $O^\circ + O^\circ \rightarrow O_2$



Application à la chimie dans le gaz

Génération d'ozone à la pression atmosphérique (Siemens, 1857) :



La pression change significativement la cinétique chimique

- Les réactions impliquant le gaz dans son état fondamental sont dominantes
- Faire très attention lors de l'utilisation d'un schéma cinétique développé pour une décharge à basse pression. Vérifier que des approximations gênantes pour une utilisation à haute pression n'ont pas été faites en particulier :
 - Les réactions à 3 corps, réactions de quenching,...peuvent devenir dominantes.
 - La formation d'excimers incluant les ions
 - La formation de métastables du gaz vecteur (états excités à longue durée de vie) qui peuvent largement contribuer au transfert de l'énergie électrique (réactions Penning) par exemple ionisation: A* + B → A + B+ + e

Sommaire

I-Pourquoi faire des décharges froides à pression atmosphérique ?

- 1. Parce qu'on a pas le choix
- 2. Pour réduire le coût d'un procédé
- 3. A cause de la spécificité de la cinétique chimique

II- Physique des décharges hors équilibre à la pression atmosphérique ?

- 1. Comment la décharge s'amorce lorsque Pxd est élevé ? - le streamer en 5 étapes
- 2. Comment éviter la transition à l'arc ?
 - Décharge couronne
 - Décharge nanoimpulsionnelle
 - Décharge contrôlée par barrière diélectrique
- 3. Quelles sont les caractéristiques des micro-décharges ?
- 4. Décharges homogènes à la pression atmosphérique
 - Couplage des avalanches électroniques
 - Claquage de Townsend à pression atmosphérique
- 5. Comparaison des différentes DBD

III- Développement d'un procédé: cas de la PECVD

CNRS PROMES



Claquage du gaz Observations expérimentales

Transition pour (Pression X distance) > 10⁴Pa.m ~ 10⁻¹ Atm.cm ~ 70 Torr.cm P α N α 1/ λ : d/ λ >>1



Le produit Pxd associé à la transition entre le claquage de Townsend et le claquage de streamer n'est pas une valeur bien définie

CNRS

PROMES

Physique des décharges hors équilibre à la pression atmosphérique

Rupture du gaz pour de forts produits Pxd ?

- Observations
- Streamer

CNRS

PROMES

- de l'avalanche électronique à l'étincelle



PROMES

H. Raether, Electron avalanches and breakdown in gases, Butterworths. London 1964

Claquage du gaz

Spécificité de la physique des décharges froides à la pression atmosphérique

(Pression X Distance inter-électrodes) > 10-1 Atm.cm (~100 Torr.cm)

 $P \alpha N \alpha 1/\lambda : d/\lambda >>1$

Observations

La décharge se développe en un temps très court (10ns) → avant que les ions aient pu atteindre la cathode La dynamique de la décharge est indépendante du type de matériau formant la cathode Un canal lumineux s'établit après le développement de la première avalanche électronique



Incompatible avec un claquage de Townsend contrôlé par α et γ

La contribution de la surface est négligeable

Théorie du "streamer": Loeb, Meek et Raether dans les années 40

CNRS PROMES Loeb L. B. 1960, Basic Processes of Gazeous Electronics,Univ. of California Press Raether H 1964 Electron avalanches and Breakdown in Gases, Butterworth Meek J. .M and Craggs J. D.,1978, electrical Breakdown of Gases, Wiley



Comment la décharge s'amorce ? 2. Avalanche Primaire



a : Coefficient attachementa: Coefficient d'ionisation

CNRS

PROMES

<u>Première étape</u>: *Création aléatoire d'un électron "primaire"*

<u>Deuxième étape</u>: *Développement d'une avalanche électronique à partir de l'électron "primaire"*

 $E_0/N > (E/N)$ critique / a/N > a/N

Dans l'air: 28 kV/cm Dans SF₆: 83 kV/cm

Comment la décharge s'amorce ? 2. Avalanche Primaire



Comment la décharge s'amorce ? 3. Naissance du streamer (ou dard)

Yu. P. Raizer (Gas Discharge Physics)



Fig. 12.3. Electric fields in a gap containing an electron avalanche. (a) Lines of force of the external field E_0 and of the field of space charge of the avalanche, E', are shown separately. (b) lines of force of the resulting field $E = E_0 + E'$. Circles mark the centers of space charges

Yu. P. Raizer (Gas Discharge Physics)

CNRS

PROMES

 Si Ne est suffisamment élevée $E' \approx E_0$ • Distorsion du champ électrique local Modification de la propagation de l'avalanche

Ne: Nombre d'électron

Troisième étape: Naissance du streamer

Comment la décharge s'amorce ? 3. Naissance du streamer



Fig. 12.3. Electric fields in a gap containing an electron avalanche. (a) Lines of force of the external field E_0 and of the field of space charge of the avalanche, E', are shown separately. (b) lines of force of the resulting field $E = E_0 + E'$. Circles mark the centers of space charges

Yu. P. Raizer (Gas Discharge Physics)

Formation du streamer si $E' \approx E_0$

E': Champ électrique dû à la charge d'espace dans l'avalanche primaire

Eo: Champ Laplacien ou géométrique Eo = V/d

Si on considère que les ions et les électrons sont 2 sphères de rayon R Le champ électrique à la surface s'écrit : E'=eNe/4 $\Pi \varepsilon_0 R^2$ with Ne = exp[α x]

$$\mathcal{E}_{0} \approx \mathcal{E}' = \frac{e}{4\pi\varepsilon_{o}r^{2}}\exp\left[\alpha\left(\frac{\mathcal{E}_{0}}{\mathcal{P}}\right)^{*}x\right]$$

Critère de Meek

CNRS PROMES

Comment la décharge s'amorce ? 3. Naissance du streamer



Quelle est l'ordre de grandeur du nombre de charges nécessaire pour avoir E'=E₀?

Ne > 10⁸, α x 18-20 Rd \approx 200 μ m, x \approx mm

on considère que les ions et les électrons sont contenus dans 2 sphères de rayon R champ à la surface est : E'=eNe/4 $\Pi \epsilon_0 R^2$ avec Ne = exp[$\alpha \times$]

Yu. P. Raizer (Gas Discharge Physics)

 $R \approx R_{d} = \sqrt{4D_{e}t}$ $V_{e} = \mu_{e}E_{0}$ $R \approx R_{d} = \sqrt{4D_{e}t} = \sqrt{4\frac{De}{\mu e}\frac{x_{0}}{E_{0}}} = \sqrt{\frac{8\overline{\varepsilon}x_{0}}{3eE_{0}}}$

<u>Cas de l'air</u>: pour un gap de 1cm, à P_{atm} , $E_c = E_0 = 31$ kV/cm avec =3,6 eV

$$R_d = 180\mu$$

CNRS

PROMES

field E_0 and of the field of space charge of the avalanche, E', are shown separately. (b) lines of

force of the resulting field $E = E_0 + E'$. Circles mark the centers of space charges

 \rightarrow E'=E₀ pour Ne=0,8 10⁸ et α x=18

Comment la décharge s'amorce ? 4. Propagation du streamer

Un streamer est un canal de décharge assez faiblement ionisé qui se propage très rapidement (v de l'ordre de 10⁸cm/s) vers une, ou vers les 2 électrodes



CNRS PROMES Le front d'ionisation se propage dans la même direction que les électrons En tête le champ est très fort: propagation rapide Les ions des avalanches secondaires forment un plasma avec les électrons du streamer

Comment la décharge s'amorce ? 4. Propagation du streamer

Streamer dirigé vers la cathode

•Le front d'ionisation et les électrons se propagent dans des directions opposées

CNRS PROMES



Fig. 12.5. Cathode-directed streamer. (a) Streamer at two consecutive moments of time, with secondary avalanches moving towards the positive head of the streamer; wavy arrows are photons that generate seed electrons for avalanches. (b) Lines of force of the field near the streamer head



• Rôle essentiel des photons qui par photo-ionisation (hV_{N2}>Ei_{O2}) ou photo-émission (cathode), créent les électrons germes à l'origine des avalanches secondaires

- Rôle des charges des avalanches secondaires:
 - Les électrons rejoignent la partie positive du streamer pour former un plasma
 - Les ions forment une nouvelle charge d'espace positive qui est plus près de la cathode
 propagation du streamer vers la cathode

Comment la décharge s'amorce? 5. Après le streamer

Streamer:propagation d'une onde d'ionisation vers les surfaces (10mA, 10⁸cm/s) Fin du streamer lorsque les surfaces sont atteintes

Les 2 électrodes sont connectées par un plasma faiblement ionisé (≈10⁻⁵)

Le plasma de la micro-décharge est ambipolaire et la tension est appliquée au point de contact avec la cathode

Forte émission secondaire

Onde d'ionization de la cathode vers l'anode, Onde de retour (10⁹cm/s) Chauffage du gaz, étincelle (10⁴A/cm², 100V/cm)

CNRS PROMES Comment éviter la transition à l'arc? 5. Après le streamer

Stopper la décharge avant que le gaz soit chauffé

- Configuration des électrode (applicateur)
 - 1- Forme : Décharge couronne
 - 3- Conductivité: Décharge à Barrière Diélectrique
- <u>Alimentation électrique</u>:

CNRS

PROMES

2- Tension impulsionnelle



Décharge couronne: Une electrode « gap





- C'est une solution tant que la tension est assez faible...
- C'est une solution pour diminuer la tension de claquage

Comment éviter la transition à l'arc? Tension impulsionnelle répétitive

La transition du streamer à l'étincelle implique un échauffement du gaz qui nécessite environ 500ns

Impulsion de tension durée < 500ns

transition à arc évitée entre 2 électrodes métallique

Ne et Te augmentent

CNRS

PROMES



C. Laux, A. Bourdon, J. M. Pouvesle,

Décharge à barriere (DBD) diélectrique





Décharge à barriere diélectrique

DBD luminescente dans He : exemple de forme de la tension gaz



Décharge à barrière diélectrique (DBD)-Configurations

















Beaucoup de configurations possibles

Décharge à barrière diélectrique caractéristiques des microdécharges



Décharge à barrière diélectrique caractéristiques des microdécharges

Temps caractéristiques



Décharge à barrière diélectrique chaque microdécharge est un micro réacteur





Fig. 11. The chemical reactions initiated by a microdischarge in "air" [18].

Need to take into account spatial gradient and many order of magnitude in time



Species are diffusing accordingly to their life time

O. Guaitella - DBDs and Coronas

Décharge à barrière diélectrique chaque microdécharge est un micro réacteur

Micro-décharges aléatoirement distribuées

③: une solution pour réaliser une chimie à peu près homogène

- Micro-décharge: 100ns
- Taux de répétition de l'ordre de : 50µs (10kHz)
- Temps de process: 1s (20 000 demie-période)

☺: Contrôle de l'énergie moyenne intégrée dans le temps et l'espace n'est pas toujours suffisant:

- Différentes chimies :

- dans le canal de décharge et dans la zone de diffusion
- dans des filaments d'énergie différente
- aux endroits où la fréquence de répétition des décharges est différente

Intérêt des décharges froides homogènes à la pression atmosphérique





Mecanismes qui aident à obtenir

un grand volume de plasma

quand le produit Pxd est élevé

Trois solutions:

- 1. Couplage d'avalanches primaires : interactions conduisent à un plasma de grand volume.
- Claquage de Townsend : avant que le champ soit suffisant pour qu'une avalanche de grande dimension se forme → pas de streamer → pas de microdécharge
- 3. Diminuer suffisamment la distance interélectrode pour que l'avalanche primaire ne puisse pas atteindre la taille critique (faible Pxd)

1^{ère} solution : couplage des avalanches électroniques



Preionisation + HT : De nombreuses avalanches se développent en même temps Si elles se recouvrent avant la transition au streamer, la décharge est homogène

Condition de recouvrement des avalanches ?

Quand les avalanches atteignent la taille critique (x_c), que N_{ec}=10⁸ : R_{dc} < a/2, a distance entre 2 e_{primaires}

Si N_{e0} est la densité de préionisation :

 $a = N_{e0}^{-1/3}$

 $N_{e0} \approx 10^6 / \text{cm}^3$

Rdc ≈ 100µm

Continuous (sinusoidal)

Rise time: ~1 V / nsec Sinusoidal wave

Filament temperature: 350-450K

Microsecond-pulsed

Rise time: $\sim 5 \text{ V} / \text{nsec}$ Pulse duration: $\sim 2 \text{ µsec}$

Filament temperature: 320-420K

Nanosecond-pulsed

Rise time: ~3,000 V / nsec Pulse duration: ~40 nsec

Rotational temperature: $\sim 300 K$

Nanosecond pulse





Drexel Plasma Institute H. Ayan *et al*, J. Phys. D: Appl. Phys. **42** (2009) 125202

ISPC 19 Bochum July 30

(a)

<u>2^{ème} solution - Principe :</u>

Obtenir un claquage du gaz pour un champ inférieur au champ de développement d'une avalanche de taille critique

⇒ obtenir un claquage de Townsend

Moyens:

- γ :Augmenter la contribution de l'émission d'électrons secondaires à la cathode avant et pendant le claquage

- Augmenter le coefficient γ

- Favoriser le bombardement de la cathode par des espèces énergétiques: ions, états excités, photons

 - α :Diminuer la vitesse d'ionisation dans le gaz afin que les ions puissent atteindre la cathode: exacerber l'ionisation via des mécanismes à plusieurs étapes comme l'ionisation Penning plutôt que l'ionisation directe par les électrons :

1)
$$e + A \rightarrow A^* + e$$

+
2) $A^* + B \rightarrow B^+ + e$
1) $e + B \rightarrow B^+ + 2e$

Si γ augmentent, da/dE lente et Vc faible \implies claquage de Townsend

Comment augmenter l'émission d'électrons secondaires ?

Emission d'électrons à la cathode dépend:

- γ: Choix du matériau qui constitue la cathode
 - Oxyde : MgO
 - Isolant chargé négativement
 - Diélectrique sur chaque électrode:

Quand le diélectrique est sur l'anode il se charge en électrons. A l'alternance suivante l'électrode est la cathode et l'émission secondaire est exacerbée en début de décharge lorsque la décharge s'amorce.

- Flux de particules pouvant induire l'émission d'électrons secondaires : effet mémoire

Ralentir l'ionisation du gaz pour laisser le temps aux ions de dériver à la cathode: Ionisation en plusieurs étape : Ionisation Penning

Ex : décharge luminescente à la pression atmosphérique dans He/air

Comparaison de l'importance de l'ionisation directe et de l'ionisation Penning *Modèle fluide 1D* (*P. Ségur*)

lonisation directe e + He => He⁺ + 2 e

Ionisation Penning e + He => He* He* + N₂ => N₂⁺ + e + He



Contrainte sur le mélange gazeux

DBD's comparison

Density (cm ⁻³)	107	10 ⁸	10 ⁹	10 ¹⁰	10 ¹¹	10 ¹²	10 ¹³	1014	10 ¹⁵
Max Ne	Townsend			Glo	Glow		Glow like Glow RF		Nano- étitive

- Les décharge luminescente (glow) ne fonctionnent que dans les mélanges Penning, les autres décharges fonctionnent dans l'air
- La densité d'électrons et leur énergie peut être varié sur une très grande plage en ne changeant que la forme de l'excitation

F. Massines, C. Sarra-Bournet, F. Fanelli, N. Naudé, N. Gherardi, Review paper, Plas. Proc. and Polym., Vol. 9, Iss. 11-12, pp 1041–1073,2012

DBD's comparison

1111111	Density (cm ⁻³)	107	10 ⁸	10 ⁹	10 ¹⁰	1011	10 ¹²	10 ¹³	1014	10 ¹⁵
In the second second	Max Ne	Towr	send		Gl	OW	Glow Glow	/ like RF	FD Na répé	BD no- titive
111111	Carrier gas metastable				Gl	ow	Town	isend		
1										

- Maximum ionization level is related to the current amplitude
- ✓ Maximum power also depends on the discharge duration

DBD homogènes	Townsend	Glow BF	Glow RF	Glow like	Nano- répétitive	VHF (150MHz)
Power W/cm ²	10	0,1	3	10	4	10

F. Massines, C. Sarra-Bournet, F. Fanelli, N. Naudé, N. Gherardi, Review paper, Plas. Proc. and Polym., Vol. 9, Iss. 11-12, pp 1041–1073,2012

Sommaire

I-Pourquoi faire des décharges froides à pression atmosphérique ?

- 1. Parce qu'on a pas le choix
- 2. Pour réduire le coût d'un procédé
- 3. A cause de la spécificité de la cinétique chimique

II- Physique des décharges hors équilibre à la pression atmosphérique ?

- 1. Comment la décharge s'amorce lorsque Pxd est élevé ? - le streamer en 5 étapes
- 2. Comment éviter la transition à l'arc ?
 - Décharge couronne
 - Décharge nanoimpulsionnelle
 - Décharge contrôlée par barrière diélectrique
- 3. Quelles sont les caractéristiques des micro-décharges ?
- 4. Décharges homogènes à la pression atmosphérique
 - Couplage des avalanches électroniques
 - Claquage de Townsend à pression atmosphérique
- 5. Comparaison des différentes DBD

CNRS PROMES

III- Développement d'un procédé: cas de la PECVD

AP-PECVD problematic

i.

Comparison of Low pressure and Atmospheric pressure PECVD parameters



SiN:H couche antireflet et passivante de cellule photovoltaïque silicium







Photo STEM de la tranche du dépôt Les points sombres sont des trous (nano)



Modélisation de l'écoulement



Recirculation de gaz même en dehors de la zone de dépôt

➔ Nano poudres si Si[•]

Elimination des recirculation par ajout de déflecteur



Photo STEM de la tranche du dépôt Les points sombres sont des trous (nano)

Modélisation de l'écoulement



Recirculation de gaz même en dehors de la zone de dépôt

➔ Nano poudres si Si[•]

Elimination des recirculation par ajout de déflecteur





Disparition des trous mais variation de la densité du dépôt

Photo STEM de la tranche du dépôt et profil SIMS



Disparition des trous mais variation de la densité du dépôt associé à une variation de la chimie du dépôt



Photo STEM de la tranche du dépôt Les points sombres sont des trous (nano)





Disparition des trous mais variation de la densité du dépôt associé à une variation de la chimie du dépôt

Modulation du plasma 🗲 chimie plus homogène

J. Vallade et al: , Energie Procedia,, Vol 27, pp 365-371, 2012, J. Phys. D: Appl. Phys. 46 (2013) 464007, J. Phys. D: Appl. Phys. 47 (2014) 224006

Tranche du dépôt

Plasma continu



Plasma modulé



Dépôt dense et uniforme dans toutes les dimensions
 Rendement des cellules photovoltaïques identiques avec un dépôt basse pression et pression atmosphérique

Résumé : décharges froides à pression atmosphérique

- Pour des Pxd > 50 Torr.cm (fonction du gaz) la contribution de l'émission secondaire devient faible comparée à l'ionisation du gaz → claquage de type streamer.
 - Développement d'une avalanche électronique qui crée $\approx 10^8$ électrons et ions
 - Champ de charge d'espace égal au champ appliqué
 - Onde d'ionisation vers l'anode
 - Onde d'ionisation vers la cathode résultant de la formation d'avalanches secondaires
- Le produit Pxd pour lequel la transition Townsend / streamer est observée dépend des conditions expérimentales
- Pour maintenir le gaz froid à la pression atmosphérique il faut interrompre la décharge avant qu'elle transite à l'arc:
 - Courbure d'une des électrodes faible par rapport à l'espace interélectrode pour que le champ varie très rapidement dans l'espace interélectrode
 - → décharge couronne
 - Diélectrique solide dans le passage du courant entre les 2 électrodes
 - → Décharge contrôlée par barrière diélectrique
 - Excitation impulsionnelle (<500ns)

Résumé : les DBD

- sont des décharges robustes obtenues dans des configurations très variées
- ont beaucoup d'applications : la chimie dans le gaz (Ozone, dépollution ...), le traitement de surface (activation de surface polymère, nettoyage de métaux, stérilisation, dépôt de couches minces ...), les sources de lumière en particulier UV et VUV qui utilisent les excimers ainsi que les sources planes de grandes dimensions, au contrôle de l'écoulement, à la combustion...
- sont normalement constituées de microdécharges
- peuvent être homogènes lorsque l'excitation est nanoimpulsionnelle, Radio Fréquence, basse fréquence dans des conditions qui permettent un claquage de Townsend
- Ont une densité électronique maximale qui varie de entre 10⁸ et 10¹⁵/cm³ suivant la forme de l'excitation et la nature du gaz
- Une puissance de 10W/cm² ou 100W/cm³ peut être atteinte avec une DBD homogène

Résumé

Du fait de la pression c'est à dire de la forte densité du gaz:

- L'ionisation dans le volume du gaz est importante
 - → claquage de streamer
 - ➔ chauffage du gaz
- La cinétique chimique est relativement spécifique
 - Les réactions impliquant le gaz dans son état fondamental sont dominantes
 - Faire très attention lors de l'utilisation d'un schéma cinétique développé pour une décharge à basse pression :

* Vérifier que des approximations gênantes pour une utilisation à haute pression n'ont pas été faites: les réactions à 3 corps, réactions de quenching,...peuvent devenir dominantes. La formation d'excimers ne peut pas être négligée ainsi que celle de métastables et donc des réactions Penning, les ions peuvent aussi être différents.

* Rajouter toutes les réactions faisant intervenir les espèces dans leur niveau fondamental.

 Le libre parcours moyen des radicaux est aussi très faible et le <u>couplage décharge</u> <u>écoulement du gas est fondamental</u>